



Металлографический микроскоп КММ-5400



Металлографический микроскоп КММ-5400 широко используется в микроэлектронной промышленности для исследования полупроводниковых пластин, кристаллов интегральных схем, LCD-модулей и других задач, в которых требуется выполнение оптического контроля. Благодаря высококачественной оптике и модульной конструкции, КММ-5400 является превосходным инструментом оптической микроскопии в проходящем и отраженном свете.

Микроскоп КММ-5400 оснащается свето- и темнопольными полуапохроматическими объективами, изготовленными с использованием современных оптических материалов и компонентов, компенсирующих все виды хроматической аберрации. Числовые апертуры объективов обеспечивают высокие разрешение и контраст изображения во всем поле зрения.

Технические характеристики объективов

Увеличение	Числовая апертура	Фокусное расстояние	Толщина покровного стекла	Парфокальное расстояние	Сопряженное фокусное расстояние
5x	0,15	19,5	0	45 мм	∞
10x	0,30	10,9			
20x	0,45	3,2			
50x	0,8	1,3			
100x	0,9	1			

Параметры	КМ-5400
Метод наблюдения	Темное поле; светлое поле; поляризация; дифференциальный интерференционно-контрастный (DIC); флуоресцентный
Оптическая система	Скорректированная на бесконечность цветная оптическая система
Оптическая головка	30° наклонная триокулярная головка (прямое изображение); сверхширокоугольное поле зрения; соотношение бинокуляр:триокуляр = 100:0 или 0:100; межцентровое расстояние окуляров 50–76 мм. 30° наклонная триокулярная головка (прямое изображение); сверхширокоугольное поле зрения; соотношение бинокуляр:триокуляр = 100:0, 20:80 или 0:100; межцентровое расстояние окуляров 50–76 мм.
Окуляры	PL10X/26,5T однофокусный, с вынесенной точкой фокусировки, с регулировкой оптической силы; PL10X/25T однофокусный, с вынесенной точкой фокусировки, с регулировкой оптической силы; PL10X/23T однофокусный, с вынесенной точкой фокусировки, с регулировкой оптической силы
Объективы	MplanFL-BD свето- и темнопольные полуапохроматические, 5x, 10x, 20x, 50x и 100x
Револьверная головка	Наклонная шестипозиционная для темного и светлого поля, с DIC слотом
Рабочий столик	Механический рабочий столик со стеклянной пластиной; диапазон перемещения 105 мм (X) и 102 мм (Y); поле проходящего света 96 x 96 мм; фиксация перемещения по оси Y; конструкция для левой или правой
Корпус	Коаксиальная грубая и точная подстройка (диапазон грубой подстройки 33 мм, шаг точной подстройки 0,001 мм). Встроенный трансформатор на 100–240 В; двойной выход электропитания; цифровой контроль регулятора силы света; переключение между проходящим и отраженным светом
Отраженный свет	RX50MRL многофункциональная подсветка: 100 Вт ртутная лампа, 75 Вт ксеноновая лампа, 100 Вт галогенная лампа (опция). Ирисовая диафрагма, слоты для фильтров и поляризаторов. RX50MRL2 свето- и темнопольная подсветка: 100 Вт галогенная лампа, переключение между отраженным и проходящим светом. Ирисовая диафрагма, слоты для фильтров и поляризаторов.
Проходящий свет	100 Вт галогенная лампа, ирисовая диафрагма. Встроенные фильтры для проходящего света (LBD, ND6, ND25), поворотной-откидной конденсор (числовая апертура 0,9)

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники